

2016年度 第2回弘前大学機器分析センターセミナー開催のお知らせ

弘前大学機器分析センターでは、走査型電子顕微鏡および透過型電子顕微鏡の基本的な原理とアプリケーションに関するセミナーを開催します。専門家にわかりやすく解説していただきますので、皆様方の多数のご参加をお待ちしております。

1. 日時： 2016年10月 5日（水） 14：30～17：30
2. 場所： 弘前大学理工学部1号館 4階 8番講義室
3. 対象： 教職員、学生、一般の方
4. 入場： 無料
5. 内容：

i) 「TEM による像観察と分析の基礎と最新技術」

日本電子（株）EM 事業ユニット 参事 近藤 行人 氏

ii) 「SEM で何が分かるのか？ SEM の基礎知識と応用、極表面情報を捉える最新技術」

日本電子（株）SM 事業ユニット SM アプリケーション部 1T 山本 康晶 氏

<お問い合わせ>

弘前大学機器分析センター長 岡崎 雅明

電話: 0172-39-3565 E-mail: mokazaki@hirosaki-u.ac.jp

<お申し込み先>

弘前大学機器分析センター 事務局

電話:0172-39-3913 E-mail: kiki@hirosaki-u.ac.jp

※ 事前予約なしでの当日のご参加も可能ですが、準備の都合上、受講を希望する方の氏名、所属、電話番号を明記の上、電子メールによりお申し込みください。